

**SEMINAR:****Ellipsometrie und Reflektometrie
zur Charakterisierung dünner Schichten**

am Dienstag, den 24. Juni 2014
Veranstaltungsort:
Novotel München Messe
Willy-Brandt-Platz 1, 81829 München-Riem

Seminarprogramm

9.00 **Begrüßung / Vorstellung des Programms**
SENTECH GmbH, Krailling

Einführung in die Messmethode Ellipsometrie

9.15 **Charakterisierung von dünnen Schichten mit Reflektometrie und Ellipsometrie**
Uwe Richter, SENTECH Instruments, Berlin

9.45 **Modellieren von ellipsometrischen Messungen mit SpectraRay/3**
Sven Peters, SENTECH Instruments, Berlin

Messung von organischen Schichten

10.15 **Messung optischer Eigenschaften von organischen Schichten zur Charakterisierung von OLEDs**
Christian Mayr, Universität Augsburg, Institut für Experimentalphysik IV

10.45 **Kaffeepause und Diskussion**

11.00 **Characterisation of anisotropic plasmonic nanostructures from template-assisted self assembly**
Christian Kuttner, Universität Bayreuth, Institut für Physikalische Chemie II

11.30 **Implementierung der spektroskopischen Ellipsometrie in der Weiterentwicklung von AD-Plasmabeschichtungstechnologie**
Artur Grishin, Plasmateat GmbH, Steinhagen

Materialforschung

12.00 **Charakterisierung von ZnO Schichten und Pufferschichten mit spektroskopischer Ellipsometrie**
Stephan Pohlner, Avancis GmbH Co. KG, München

12.30 **Characterization of coatings with huge internal surfaces by using ellipsometry**
Mikhail Baklanov, IMEC Leuven, Belgien

13.00 **Mittagessen und Diskussion**

14.00 **Schwingungsspektroskopie an dünnen Schichten mit spektroskopischer Ellipsometrie**
Sven Peters, SENTECH Instruments, Berlin

Prozesskontrolle bei Abscheideprozessen

14.30 **Prozesskontrolle von PVD Prozessen mit Spektroskopischer Ellipsometrie**
Georg Dittmar, SENTECH Instruments, Berlin

15.00 **Kaffeepause und Diskussion**

15.15 **Realtime Monitoring von ALD-Prozessen mit In-Situ Ellipsometrie**
Hassan Gargouri, SENTECH Instruments, Berlin

15.45 **Alle Teilnehmer des Seminars sind eingeladen, die ausgestellten Ellipsometer zu besichtigen**

17.00 **Ende des Seminars**